(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

特許第5181406号 (P5181406)

(45) 発行日 平成25年4月10日(2013.4.10)

(24) 登録日 平成25年1月25日(2013.1.25)

(51) Int. CL. FLBO1J 31/22 \mathbf{Z} (2006, 01) BO1J 31/22COTC 2/32 (2006, 01)CO7C 2/32CO7C 11/107 (2006.01) CO7C 11/107 CO7B 61/00 (2006.01) CO7B 61/00 300

請求項の数 7 (全 16 頁)

特願2001-285189 (P2001-285189) (21) 出願番号 (22) 出願日 平成13年9月19日 (2001.9.19) (65) 公開番号 特開2002-233765 (P2002-233765A) 平成14年8月20日 (2002.8.20) (43) 公開日 審査請求日 平成20年8月13日 (2008.8.13) (31) 優先権主張番号 特願2000-302870 (P2000-302870) 平成12年9月29日 (2000.9.29) (32) 優先日 (33) 優先権主張国 日本国(JP)

(31) 優先権主張番号 特願2000-374702 (P2000-374702) (32) 優先日 平成12年12月5日 (2000.12.5)

(33) 優先権主張国 日本国(JP)

(73) 特許権者 000003300

東ソー株式会社

山口県周南市開成町4560番地

(72) 発明者 吉田 統

三重県桑名市新西方5-304

||(72)発明者 山本 敏秀

三重県四日市市別名3丁目5-1

(72)発明者 岡田 久則

三重県四日市市垂坂町366-1

||(72)発明者 村北 栄之

三重県四日市市別名3丁目4-1

審査官 後藤 政博

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】エチレンの三量化触媒およびこの触媒を用いたエチレンの三量化方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記一般式(1)

ACrBn (1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、および炭素数1~10の直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した、トリス(3・(4・トリル)・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・フェニル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・ジメチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・セラゾリル)・5・メチル・1・ピラゾリル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(2・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(1・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(4・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(4・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・1)からなる群より選択されるクロム錯体とアルキルアルミノキサンからなるエチレンの三量化触媒。

【請求項2】

下記一般式(1)

ACrBn

(1)

20

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、および炭素数1~10の直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した、トリス(3・(4・トリル)・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・フェニル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・ジメチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・セリジル・1・ピラゾリル)、メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(2・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(2・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(4・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(4・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(4・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(4・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)からなる群より選択されるクロム錯体とアルキルアルミノキサンとトリアルキルアルミニウム化合物であるアルキル基含有化合物からなるエチレンの三量化触媒。

【請求項3】

三脚型構造を有する中性の多座配位子が<u>facialに配位したクロム錯体を用いる</u>ことを特徴とする請求項1または2に記載のエチレンの三量化触媒。

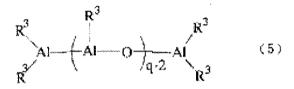
【請求項4】

アルキルアルミノキサンが、下式(4)および/または(5)

【化1】



【化2】



<u>(ここで、R³ は互いに同じでも異なっていてもよく、水素原子、または炭素数 1 ~ 2 0 の炭化水素基であり、 q は 2 ~ 6 0 の整数である。)で表される</u>請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項5】

請求項1~4のいずれかに記載のエチレンの三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【請求項6】

エチレンの存在下に、下記一般式(1)

ACrBn (1)

 10

20

30

40

<u>I)からなる群より選択されるクロム錯体とアルキルアルミノキサンを接触させてなるエチレンの三量化触媒を用いて、</u>エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【請求項7】

エチレンの存在下に、下記一般式(1)

ACrBn (1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、および炭素数1~10の直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した、トリス(3・(4・トリル)・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・フェニル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・ジメチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・フェニル・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(2・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(3・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(4・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(4・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(II)からなる群より選択されるクロム錯体とアルキルアルミノキサンとトリアルキルアルミニウム化合物であるアルキル基含有化合物を接触させてなるエチレンの三量化触媒を用いて、エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、エチレンの三量化触媒およびこの触媒を用いたエチレンの三量化方法に関する。さらに詳しくは、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)の原料コモノマーとして有用な1・ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造するエチレンの三量化触媒、およびその触媒を用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

エチレンを三量化して1・ヘキセンを得る方法において、クロム化合物を触媒として用いることは公知である。例えば、特開昭62-265237号公報にはクロム化合物、ポリヒドロカルビルアルミニウムオキシドおよびドナー配位子からなる触媒系が開示されている。特開平6-239920号公報には、クロム化合物、ピロール含有化合物、金属アルキル化合物およびハライドからなる触媒系が、また特開平8-59732号公報には、クロム化合物、金属アルキル化合物および酸アミドまたはイミド化合物からなる触媒系が開示されている。

[0003]

また、特開平6-298673号公報には、クロミウム塩の多座配位子であるホスフィン、アルシンおよび/またはスチビンとの配位錯体とアルミノキサンからなる触媒が開示されている。さらに、特開平10-7712号公報には、特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が、特開平10-231317号公報には、環状ポリアミンまたはヒドロトリス(ピラゾリル)ボレートが配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、特開昭62-265237号公報に記載の方法では、1-ヘキセンと同時にポリエチレンが多く副生する欠点があった。特開平6-239920号公報に記載の方法は、ポリエチレンの副生が少なく、この点ではかなり改善している。しかし、触媒の構成成分であるピロール含有化合物は、空気に対して極めて不安定な物質であるため着色して劣化しやすい。従って、取り扱いが難しいばかりか、反応終了後には着色成分を除去するため

10

20

30

40

の処理または新たな装置を必要とする等、工業的な触媒としては十分なものではなかった。また、特開平8-59732号公報に記載の方法では、触媒の構成成分である酸アミドまたはイミド化合物の化合物群の中で活性を得るには、ある特定のイミド化合物(即ちマレイミド)を用いる必要がある。マレイミドは溶解性が低いため触媒調製が煩雑であり、入手が難しいばかりか高価であり、経済性の面においても問題がある。

[0005]

一方、特開平6-298673号公報に記載の方法では、実験データの再現性が乏しい。また、特開平10-7712号公報に記載の方法は、触媒活性が低いという問題がある。さらに、特開平10-231317号公報に記載の方法は、ポリエチレンの生成が多いばかりか、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低いという欠点がある。

[0006]

本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的はLLDPEの原料コモノマーとして有用な1 - ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造し、しかも取り扱いの容易なエチレンの三量化触媒、およびこの触媒を用いたエチレンの三量化方法を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、特定の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル基含有化合物からなるエチレンの三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いると高い活性でエチレンの三量化反応が進行し、高選択的に1・ヘキセンが生成することを見い出し、本発明を完成するに至った。

[0008]

即ち本発明は、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル基含有化合物からなるエチレンの三量化触媒およびそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0009]

【発明の実施の形態】

次に、本発明についてさらに詳しく説明する。

[0010]

本発明においては、エチレンの三量化触媒を構成する一成分として、下記一般式 (1) A C r B n (1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、および炭素数1~10の直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した、トリス(3・(4・トリル)・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・フェニル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・ジメチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・フェニル・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(2・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(3・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(3・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3・(4・ピリジル)・5・メチル・1・ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III

[0011]

ここで、クロム錯体に配位させる三脚型構造を有する中性の多座配位子として用いられる ものは特に限定されないが、例えば、下記一般式 (2)

[0012]

【化3】

10

20

30

$$R^{1} - G^{i} \xrightarrow{D^{1}_{j}} L^{1}$$

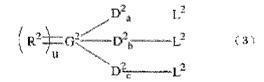
$$D^{1}_{m} - L^{1}$$

$$(2)$$

(式中、 j , k , m はそれぞれ独立して 0 ~ 6 の整数である。 D 1 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい 2 価の炭化水素基、 L 1 はそれぞれ独立して周期表 1 4 族、 1 5 族、 1 6 族または 1 7 族元素を含有する置換基を表す。また、 G 1 は炭素またはケイ素、 R 1 は水素原子、炭素数 1 ~ 1 0 のアルキル基または炭素数 6 ~ 1 0 のアリール基を表す。)または下記一般式(3)

[0013]

【化4】



(式中、a , b , c はそれぞれ独立して 0 ~ 6 の整数であり、u は 0 または 1 の整数である。 $\underline{D^2}$ はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい 2 価の炭化水素基、 $\underline{L^2}$ はそれぞれ独立して周期表 1 4 族、 1 5 族、 1 6 族または 1 7 族元素を含有する置換基を表す。また、 $\underline{G^2}$ は窒素原子またはリン原子、 $\underline{R^2}$ は酸素原子またはイオウ原子を表す。)で示される三座配位子が好適なものとして挙げられる。

[0014]

上記一般式(2)および(3)において、 D^1 および D^2 としては特に限定されるものではないが、例えば、アルキレン基、シクロアルキレン基、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基等が挙げられる。また、その置換基としては、例えば、メチル基、エチル基等のアルキル基類、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基類等が挙げられる。

[0015]

一般式(2)および(3)において、 L^1 および L^2 で示される周期表 1 4 族、 1 5 族、 1 6 族または 1 7 族元素を含有する置換基は特に限定されるものではないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基等のアルコキシ基類、フェノキシ基、 2 , 6 - ジメチルフェノキシ基等のアリールオキシ基類、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ブチルチオ基等のアルキルチオ基類、フェニルチオ基、トリルチオ基等のアリールチオ基類、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ビス(トリメチルシリル)アミノ基等のジアルキルアミノ基類、ジフェニルアミノ基等のジアリールアミノ基類、メチルフェニル基等のアルキルアリールアミノ基類、ジメチルホスフィノ基、ジエチルホスフィノ基等のジアリールホスフィノ基類、ジフェニルホスフィノ基等のアルキルアリールホスフィノ基類が挙げられる。

[0016]

また、フリル基、ベンゾフリル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、トリアゾリル基、テトラゾリル基、ピリジル基、イミダゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、インダゾリル基、キノリル基、イソキノリル基、オキサゾリル基、チアゾール基等の周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する複素環基類が挙げられる。これらの複素環基類の環上の置換基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、オクチル基、フェニル基等が挙げられる。

[0017]

一般式(2)におけるR¹は特に限定されるものではないが、例えば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ベンジル基、ヒドロキシメチル基、シアノエチル

10

20

30

40

20

30

40

50

基、アリル基、トリフルオロプロピル基等の炭素数 1 ~ 1 0 のアルキル基類、またはフェニル基、 p - メチルフェニル基、 p - クロロフェニル基等の炭素数 6 ~ 1 0 のアリール基類が挙げられる。

[0018]

[0019]

さらに、周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する複素環基を持つ多座 配位子としては、トリフリルメタン、トリス(5-メチル-2-フリル)メタン、トリス (5 - エチル - 2 - フリル) メタン、トリス(5 - ブチル - 2 - フリル) メタン、 1 , 1 , 1 - トリフリルエタン、トリフリルアミン、トリフリルホスフィン、トリフリルホスフ ィンオキシド等の含酸素三座配位子類、トリス(チエニル)メタン等の含イオウ三座配位 子類、トリ(1・ピラゾリル)メタン、トリス(3,5・ジメチル・1・ピラゾリル)メ タン、トリス(3,5‐ジイソプロピル‐1‐ピラゾリル)メタン、トリス(3,5‐ジ フェニル・1 - ピラゾリル)メタン、1,1、1 - トリス(3,5 - ジメチル・1 - ピラ ゾリル)エタン、1,1,1-トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)プロパン、 1,1,1-トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)ブタン、トリス(2-ピリジ ル)メタン、トリス(6-メチル-2-ピリジル)メタン、トリス(2-ピリジル)アミ ン、トリス(2-ピリジル)ホスフィン、トリス(2-ピリジル)ホスフィンオキシド、 トリス(2 - ピリジル)ヒドロキシメタン、トリス(1 - イミダゾリル)メタン、トリス (3 , 5 - ジメチル - 1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 , 5 - ジエチル - 1 - ピラゾ リル)メタン、トリス(3,4,5-トリメチル-1-ピラゾリル)メタン、トリス(3 , 5 - ジメチル - 4 - n - ブチル - 1 - ピラゾリル) メタン、トリス(3 - フェニル - 5 - メチル - 1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 - (4 - トリル) - 5 - メチル - 1 - ピ ラゾリル)メタン、トリス(3-(4-アニシル)-5-メチル-1-ピラゾリル)メタ ン、トリス(3-(2-ピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリル)メタン、トリス(3 - (3- ピリジル) - 5 - メチル - 1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 - (4 - ピリジ ル) - 5 - メチル - 1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 - フェニル - 1 - ピラゾリル) メタン、1 - メチル - トリス(3 - フェニル - 1 - ピラゾリル)メタン、メチル - トリス (3-エチル-1-ピラゾリル)メタン、メチル-トリス(3-フェニル-1-ピラゾリ ル)メタン、メチル・トリス(3,5・ジメチル・1・ピラゾリル)メタン、トリス(3 - (4 - トリル) - 1 - ピラゾリル) メタン、トリス (3 - (4 - アニシル) - 1 - ピラ ゾリル)メタン、トリス(3-プロピル-1-ピラゾリル)メタン、トリス(3-エチル - 1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 - メチル・1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 - t - ブチル - 1 - ピラゾリル)メタン等の含窒素三座配位子類が挙げられる。

[0020]

本発明において、上記一般式(1)のBで用いられるハロゲン原子は特に限定されるものではないが、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子等が挙げられる

20

30

40

50

。また、直鎖もしくは分岐状のアルキル基としては特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基またはフェニル基等が挙げられる。

[0021]

上記一般式(1)で示されるクロム錯体の具体的な例としては特に限定されるものではな いが、例えば、トリス(メトキシメチル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリ ス(メトキシメチル)メタンクロム(ベンジル)ジクロライド(III)、1,1,1-トリス (メトキシメチル) エタンクロムトリクロライド (III)、1,1,1-トリス (エトキシメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1-トリス(ブト キシメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1-トリス(フェノキシ メチル) エタンクロムトリクロライド(III)、トリフリルメタンクロムトリクロライ ド(III)、1,1,1-トリス(メチルチオメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1-トリス(ジメチルアミノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、トリス(ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3, 5 - ジメチル - 1 - ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3 , 5 - ジエチル - 1 - ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3, 5 - ジメチル - 1 - ピラゾリル) - メチル - メタンクロムトリクロライド(III)、ト リス(3-フェニル-5-メチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(II I) 、トリス(3-(2-ピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリ クロライド(III)、トリス(3-(3-ピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリル) メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3-(4-ピリジル)-5-メチル-1 - ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3 - フェニル - 1 -ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3-(3-トリル)-5 - メチル - 1 - ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3 - (3 アニシル) - 5 - メチル - 1 - ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、 トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロム(ヒドリド)ジクロライド(III)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロム(ベンジル)ジク ロライド(III)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロム(エチ ル)ジクロライド(III)、トリス(3,5‐ジメチル‐1‐ピラゾリル)メタンクロ ムトリベンジル(III)、1,1,1-トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル) エタンクロムトリクロライド(I I I)、トリス(3,5-ジイソプロピル-1-ピラゾ リル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3-イソプロピル-1-ピラゾ リル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3-エチル-1-ピラゾリル) メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3,5‐ジフェニル‐1‐ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(2-ピリジル)メタンクロムトリク ロライド(III)、トリス(6-メチル-2-ピリジル)メタンクロムトリクロライド (III)、トリス(2-ピリジル)アミンクロムトリクロライド(III)、トリス(1 - イミダゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1 - トリス(ジメ チルホスフィノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1-トリス(ジフェニルホスフィノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1-ト リス(ジエチルホスフィノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)等が挙げられ る。

[0022]

これらのうち触媒活性の面から、一般式(1)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子としては、複素環基を持つ含窒素三座配位子類が好ましく用いられ、より好ましくはトリス(3 - (4 - トリル) - 1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 - フェニル - 1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 - (2 - ピリジル) - 5 - メチル - 1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 - (2 - ピリジル) - 5 - メチル - 1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 - (3 - ピリジル) - 5 - メチル - 1 - ピラゾリル)メタン、トリス(3 - (4 - ピリジル) - 5 - メチル - 1 - ピラゾリル)メ

タンが用いられる。また、Bとしてはハロゲン原子が好ましく用いられる。さらに好ましい三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体としては、3-(4-k)ル) - 1-k ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(111)、トリス(3-7 エニル - 1-k ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(111)、トリス(3-7 エニル - 1-k ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(111)、トリス(3-7 エニル - 1-k チル - 1-k ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(111)、トリス(3-(2-k) エリジル) - 1-k チル - 1-k ピリジル) - 1-k ピリジル) - 1-k チル - 1-k ピリジリル) メタンクロムトリクロライド(111)等が用いられる。

[0023]

本発明において、上記の三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体の合成法は特に限定されるものではないが、例えば、多座配位子とクロム化合物とから公知の錯体形成法[例えば、Inorg.Chem.,25,1080(1986)等]により容易に合成することができる。この場合、使用できるクロム化合物としては特に限定されるものではないが、例えば、塩化クロム(III)、塩化クロム(III)、臭化クロム(III)、フルクロム(III)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(III)、フッ化クロム(III)、フットリス(テトラヒドロフラン)クロムトリクロライド(III)、トリス(ジエチルエーテル)クロムトリクロライド(III)、トリス(ピリジン)クロムトリクロライド(III)、トリス(ピリジン)クロムトリクロライド(III)、トリス(ピリジン)クロムトリクロライド(III)、トリス(アセトニトリル)クロムトリクロライド(III)、

[0024]

前記の多座配位子とクロム化合物を反応させ、クロム錯体を形成させる際のクロム金属の 濃度は特に制限されない。また、ここで用いられる溶媒としては特に限定されるものでは ないが、有機溶媒が好ましく用いられる。例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オク タン、ノナン、デカン、シクロヘキサン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、ト ルエン、キシレン、クメン、トリメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテ ル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等の ハロゲン化炭化水素類が挙げられる。また、上記溶媒はそれぞれ単独で使用し得るのみな らず、二種以上を混合して用いることも可能である。

[0025]

また、錯体形成反応は、・80 から使用する反応溶媒の沸点までの任意の温度で行われ、好ましくは20~200 である。反応溶媒の沸点以上の温度で錯形成反応を行う場合には、加圧下で行うこともできる。反応時間は特に制限されず、通常1分~48時間、好ましくは5分~24時間である。なお、反応時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料および溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

[0026]

さらに別途合成法として、上記の方法により合成した三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロムハロゲン錯体を原料に、アルキルアルミノキサンや金属ヒドリド化合物を溶媒中で反応させて、本発明の三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体を合成してもよい。

[0027]

多座配位子が配位したクロム錯体は、通常固体として沈殿するので、ろ別により反応溶媒から分離できる。さらに、必要に応じて、上記溶媒を用いて洗浄を行い、次いで乾燥してエチレンの三量化触媒の構成成分の一つであるクロム錯体が合成される。なお、沈殿しない場合は、溶媒留去、貧溶媒の添加あるいは冷却処理等により沈殿させることができる。

[0028]

本発明においては、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体のうち、 その多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることが好ましい。多座配位 10

20

30

40

30

40

50

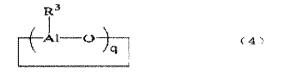
子が facialに配位したクロム錯体を用いることにより、ポリエチレンの副生が抑えられる等の効果が認められる。ここで、多座配位子が facialに配位した錯体とは、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体の異性体の一つである[化学選書 有機金属化学 - 基礎と応用 - 、143頁(裳華房)]。即ち、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体において、多座配位子が、3つの配位座が互いにシス位になるような配置で配位していることを意味する。

[0029]

本発明において使用されるアルキルアルミノキサンは特に限定されるものではないが、下記一般式(4)および/または(5)

[0030]

【化5】



【化6】

(ここで、 R 3 は互いに同じでも異なっていてもよく、水素原子、または炭素数 1 ~ 2 0 の炭化水素基であり、 q は 2 ~ 6 0 の整数である。)で表される、アルミニウムと酸素の結合を有するアルミニウムオキシ化合物である。一般式(4)および(5)において、 R 3 は各々同一でも異なっていてもよい。 R 3 は、例えば、水素原子、またはメチル基、エチル基、プロピル基、 n - ブチル基、イソブチル基、 t e r t - ブチル基などで表すことができる炭素数 1 ~ 2 0 の炭化水素基である。また、 q は 2 ~ 6 0 の整数である。用いられるアルキルアルミノキサンの使用量は、クロム錯体 1 モルに対してアルミニウムが 0 . 1 ~ 1 0 0 0 0 当量であり、好ましくは 0 . 5 ~ 8 0 0 0 当量、より好ましくは 1 ~ 5 0 0 0 当量である。

[0031]

本発明において使用されるアルキル基含有化合物は特に限定されるものではないが、例えば、下記一般式(6)

 $R_{p}MX_{q}$ (6)

(式中、pは0 < p 3であり、qは0 q < 3であって、しかもp + qは1 ~ 3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、Xは水素原子、炭素数1~10のアルコキシド基、炭素数6~10のアリール基およびハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)

で示される化合物が好適なものとして挙げられる。

[0032]

上記一般式(6)において、炭素数 1~10のアルキル基は特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基またはオクチル基等が挙げられる。アルコキシド基としては特に限定されるものではないが、例えば、メトキシド基、エトキシド基、ブトキシド基またはフェノキシド基等が挙げられる。アリール基としては特に限定されるものではないが、例えば、フェニル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては特に限定されるものではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素またはヨウ素が挙げられる。

20

30

40

50

[0033]

[0034]

上記一般式(6)で示されるアルキル基含有化合物としては、例えば、メチルリチウム、 エチルリチウム、プロピルリチウム、 n - ブチルリチウム、 s e c - ブチルリチウム、 t ert - ブチルリチウム、ジエチルマグネシウム、エチルブチルマグネシウム、エチルク ロロマグネシウム、エチルブロモマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジエチル亜鉛、ジブチル 亜鉛、トリメチルボラン、トリエチルボラン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム、トリ・n - ブチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリ・n - へ キシルアルミニウム、トリ・n - オクチルアルミニウム、トリシクロヘキシルアルミニウ ム、ジメチルエチルアルミニウム、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソプチルアルミ ニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエトキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシド ジシクロヘキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウムエトキシクロリド、ジエ チルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムブロミド、ジイソブチルアルミニウム クロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、メチルアルミニウムセスキクロリド 、エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアル ミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウムジクロリド等が挙げられる。これらのうち 入手の容易さおよび活性の面から、トリアルキルアルミニウム化合物が好ましく用いられ 、さらに好ましくはトリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチル アルミニウム、トリ・n-ブチルアルミニウム、トリ-n-ヘキシルアルミニウムまたは トリ・n・オクチルアルミニウムが用いられる。これらのアルキル基含有化合物は単独で 使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。用いられるアルキ ル基含有化合物の使用量は、クロム錯体1モルに対して0.1~10000当量であり、 好ましくは3~3000当量、より好ましくは5~2000当量である。

[0035]

本発明の三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル基含有化合物からなるエチレンの三量化触媒は、前記のクロム錯体とアルキルアルミノキサン、およびアルキル基含有化合物を原料に、溶媒中で接触させることにより調製できる。接触方法は特に制限されないが、エチレンの存在下に、これら原料を接触させると触媒の活性が向上するため好ましい。

[0036]

この触媒を調製する際のクロム錯体の濃度は特に制限されないが、通常、溶媒11あたり 0 . 0 0 1 マイクロモル~10 0 ミリモル、好ましくは 0 . 0 1 マイクロモル~1 0 ミリモルの濃度で使用される。 0 . 0 0 1 マイクロモルより小さい触媒濃度では十分な活性が得られず、逆に10 0 ミリモルより大きい触媒濃度では触媒活性が増加せず経済的 へってった。 また、ここで用いられる溶媒としては、例えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ペンタン、イソオクタン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、テルベンゼン、カリン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、トリメチルベンゼン、カローベンゼン等の方香族炭化水素類が挙げられる。また、反応生成物、即ち、1 - へみついて、クリロエタン等の塩素化炭化水素類が挙げられる。また、反応生成物、即ち、1 - へみついて、で溶媒として用いることもできる。ここで、エチレンの三量化反応時のクロム錯体濃度をコントロールする目的で、必要に応じて濃縮や希釈しても差し支えない。

[0037]

また、前記のクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル基含有化合物を接触させる際の温度は・100~250、好

ましくは0~200 である。接触時間は特に制限されず、1分~24時間、好ましくは2分~2時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料および溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

[0038]

本発明のエチレンの三量化反応は、前記のクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル基含有化合物からなる触媒とエチレンを接触させることにより行うことができる。接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化反応の原料であるエチレンの存在下に、クロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル基含有化合物を接触させて、接触と同時に三量化反応を開始する方法、またはクロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル基含有化合物を前もって接触させた後、エチレンと接触させて三量化反応を行う方法が採られる。また、これらの混合順序は特に制限されない。なお、エチレンの存在下に、クロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル基含有化合物を接触させて触媒を調製する際の反応容器中のエチレン分圧は0.00001~10000kg/cm²であり、好ましくは0.1~3000kg/cm²であり、特に好ましくは1~2000kg/cm²の範囲である。

[0039]

本発明におけるエチレンの三量化反応の温度は、 - 100~500 であるが、好ましくは0~300 である。反応圧力は、反応系がエチレン雰囲気であれば特に制限されないが、通常、絶対圧で0.01~3000kg/cm²であり、好ましくは0.1~2000kg/cm²である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレンには、反応に不活性なガス、例えば、窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。なお、エチレン三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

[0040]

本発明におけるエチレンの三量化反応は、回分式、半回分式、連続式のいずれでも実施できる。エチレンの三量化反応終了後、反応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の失活剤を添加して反応を停止させることができる。失活した廃クロム触媒は公知の脱灰処理方法、例えば、水またはアルカリ水溶液による抽出等で除去できる。生成した1・ヘキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液より分離される。また、副生するポリエチレンは、反応液出口で公知の遠心分離法や1・ヘキセンを蒸留分離する際の残渣として分離除去することができる。

[0041]

【実施例】

以下に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すもので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

[0042]

IR測定:

IRは、島津製作所製 赤外分光光度計(FTIR-8100)を用いて、ヌジョール法で測定した。

[0043]

ガスクロマトグラフィーによる分析:

反応液中に含まれる炭素数 4 ~ 8 の生成物の定量は、 GL サイエンス製 TC-1 のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ(GC-1 4 A)を用いて分析した。分析条件は、 窒素キャリアを用い、インジェクション温度 2 8 0 、 検出器温度 2 8 0 に設定し、内部標準として n- ペプタンを用いた。分析は、 このガスクロマトグラフに反応液を 1.2μ 1 注入した後、カラムの温度を 40 から 250 まで昇温することにより

10

20

30

40

行った。

[0044]

また、炭素数10以上の生成物は、上記ガスクロマトグラフとは別途用意したGLサイエンス製 TC-1のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ(GC-14A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度300、検出器温度300 に設定し、内部標準としてn-ヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.4μ1注入した後、カラムの温度を50 から300まで昇温することにより行った。

[0045]

気体中に含まれる生成物は、クロムパック製 $A1_2O_3/KC1$ のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ(GC-9A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度200、検出器温度200 およびカラム温度120 に設定し、絶対検量線法を用いた。分析は、このガスクロマトグラフに回収した気体を0.2ml注入することにより行った。

[0046]

参考例1

内容積100m1のシュレンク管に、J.Amer.Chem.Soc.,92,5118(1970)に記載の方法で合成した三脚型構造を有するトリス(3,5-ジメチル・1-ピラゾリル)メタン 126mg、トリス(テトラヒドロフラン)クロムトリクロライド(III)143mg、テトラヒドロフラン20m1を加え、窒素雰囲気下で12時間攪拌した。生成した結晶をろ別し、トリス(3,5-ジメチル・1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)を得た(IR(ヌジョール):1565cm-1)。以下、この錯体を錯体Aと称する。

[0047]

参考例 2

内容積100mlのシュレンク管に、J.Amer.Chem.Soc.,92,5118(1970)に記載の方法で合成した三脚型構造を有するトリス(3-フェニル-5-メチル-1-ピラゾリル)メタン 346mg、トリス(テトラヒドロフラン)クロムトリクロライド(III)255mg、テトラヒドロフラン5mlとトルエン20mlを加え、窒素雰囲気下で24時間95 で攪拌した。生成した結晶をろ別し、トリス(3-フェニル-5-メチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)を得た(IR(KBr):1566cm⁻¹)。以下、この錯体を錯体Bと称する。

[0048]

比較例1

温度計および攪拌装置を備えた内容積300mlのステンレス製耐圧反応容器に、窒素下で、参考例1で合成した錯体Aを1.4mgと乾燥したトルエン60mlを入れ、混合撹拌した。撹拌速度を1000rpmに調整後、0.334mmol/lのトリ-n-オクチルアルミニウム/トルエン溶液3.2mlを導入し、混合攪拌を30分行った。

[0049]

反応容器を80 に加熱し、反応容器内の圧力を40kg/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始した。以後、前記圧力を維持するようにエチレンガスを導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

[0050]

反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。反応条件および結果を表 1 ,表 2 に示す

[0051]

実施例1~3

温度計および攪拌装置を備えた内容積300m1のステンレス製耐圧反応容器に、窒素下

20

10

30

30

40

で、表1に示した所定量の錯体(参考例1で合成した錯体A)、乾燥したトルエン60m 1、メチルアルミノキサンもしくはメチルアルミノキサンとアルキル基含有化合物を入れ、30分間混合撹拌した。

[0052]

次いで、反応容器を 8.0 に加熱し、撹拌速度を 1.0.0 の 0 r p m に調整後、反応容器内の圧力を 4.0 k g / c m 2 となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始した。以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で 3.0 分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

[0053]

反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。反応条件および結果を表 1 ,表 2 に示す

[0054]

実施例4~7

温度計および攪拌装置を備えた内容積300mlのステンレス製耐圧反応容器に、反応容器内のエチレン分圧が30kg/cm²となるようにエチレンを吹き込み、撹拌を行った。表1に示した所定量の錯体(参考例1と参考例2で合成した錯体Aまたは錯体B)、乾燥したトルエン60ml、およびメチルアルミノキサン、もしくはメチルアルミノキサンとアルキル基含有化合物を窒素で圧入し、30分間混合撹拌した。

[0055]

次いで、反応容器を 80 に加熱し、撹拌速度を 1000 r p m に調整後、エチレン分圧を 40 k g / c m 2 にしてエチレンの三量化反応を開始した。以後、前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を保った状態で 30 分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

[0056]

反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。反応条件および結果を表 1 ,表 2 に示す

[0057]

【表1】

30

10

み組成
の仕込。
化反応
シ3量1
エチレ
- '

実験番号	アルキルアルミノキサン(*1) アルキル基含有化合物(*2)	(5*)姚号小草含草ル字加く
	(AI/Crモル比)	(AI/Grモル比)
比較例1	なし	360(*3)
実施例1	180(*5)	480(*4)
実施例2		なし
実施例3	180(*5)	なし
実施例4	360(*6)	
実施例5	180(*5)	
実施例6	360(*6)	なし
実施例7	120(*7)	240(*8)

(*8)174mmol/l溶液を2.1ml使用. (*1)メチルアルミ/キサン使用。(*2)トリアルキルアルミニウム使用(表2脚注の反応条件の項を参照)(*3)334mmol/1溶液を3.2ml使用。(*4)334mmol/1溶液を1.6ml使用。(*5)56mmol/1溶液を9.8ml使用。(*6)174mmol/1溶液を6.2ml使用。(*7)174mmol/1溶液を3.2ml使用。(*8)174mmol/1溶液を2.1ml使用

10

20

30

【表2】

2. エチレン3量化反応の結果

										錯体A(3μmol、1.4mg)、トリ-n-オクチルアルミニウム、エチレン分圧(40kg/cm2)、80°C、30分、1
α - 神(医(*)	[wt%]	8.66	6.66	6.66	6.66	8.66	6.66	99.5	99.2	ミニウム、エチレン分
vt»]	子附80	22.7	12.5	7.4	5.4	6.7	12.2	0.3	2.8	ナクチルアル
オリコマー分率 [wt%]	90	77.2	87.2	92.3	94.4	93.0	87.5	9.66	96.8),
イソコ	C4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	nol, 1.4mg
ホリマー/ 生成1	[wt%]	<0.1	1.2	2.1	2.1	^ 0.1	6.0	ا.5 ت	0.4	錯体A(3 μr
一へキセン活性 ホ	[g/l-触媒溶液/h]	26.3	51.4	61.2	46.2	77.3	69.0	9.66	82.2	実施例1と5については、
	[kg/g-Cr/h]	11.4	20.7	24.5	18.5	33.5	29.9	40.1		比較例12実施6
夫賊留戶		比較例1	実施例1	挥	提	実施例4	摇	插句	摆	反応条件

欖拌速度(1000rpm). : 実施例6については、錯体B(3ヶmol、1.9mg)、エチレン分圧(40kg/em2)、80°C、30分、攪拌速度(1000rpm). : 実施例7については、錯体B(3ヶmol、1.9mg)、ドリ-iso-ブチルアルミニウム、エチレン分圧(40kg/em2)、80°C、30分、攪拌速度(1000rpm). リゴマー中の1ーへキセン分率. 実施例2~4については、錯体A(3 m mol、1.4mg)、エチレン分圧(40kg/cm2)、80°C、30分、攪拌速度(1000rpm) 风马条件 风马条件 风马条件 (*1)06才少

10

20

30

40

【発明の効果】

本発明によれば、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキルアルミノキサン、あるいは当該クロム錯体とアルキルアルミノキサンとアルキル基含有化合物からなるエチレンの三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いるとエチレンから効率よく、かつ高選択的に1 - ヘキセンを製造することができる。

フロントページの続き

(56)参考文献 特開2000-202299(JP,A)

特開平05-221882(JP,A)

米国特許第06180552(US,B1)

特開平06-298673(JP,A)

特開平08-183747(JP,A)

特開平09-268134(JP,A)

特開平06-254402(JP,A)

特開2000-229240(JP,A)

特開2000-229241(JP,A)

特開2001-009290(JP,A)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

B01J 21/00 - 38/74

C07C 2/32

CO7C 11/107

C07B 61/00